



ガスクリーン IV

大流量の半導体プロセスガス用コンパクトフィルター



“ガスクリーン”IVは、コンパクトな外形からは想像ができないほどの優れた流量—圧力損失特性を持つ画期的なフィルターです。したがって、最小限のスペースで大流量処理が可能になりました。フィルターメディアおよびサポートはすべてフッ素樹脂製で、またハウジング材質には高品質のステンレスを使用しているため、ほとんどすべての半導体プロセスに使用が可能です。その他、細部にわたって従来のフッ素樹脂膜ガスフィルターを越える仕様を盛り込んだ新時代のガスフィルターです。

特長

- 低い圧力損失
- コンパクトな外形
- 非常に小さい内容積
- Oリングのないシール構造
- 出荷前のプレコンディショニング

利点

- 大流量処理が可能
- 最小限の設置スペースで装着可能
- 優れたガス置換特性
- 幅広い流体適合性、高温での使用が可能
- 速やかなドライダウン、ガス純度の維持

■材質

構成部品	材 質
フィルターメディア	PTFE
メディアサポート	フッ素樹脂
コア、エンドキャップ	PFA
フィルターハウジング	316Lステンレススチール (VAR)

■仕様

定格ろ過精度 (μm)* ¹	0.003* ²
最高使用圧力 (140℃)	1 MPaG* ³
耐差圧 (38℃)	0.7 MPa
耐逆差圧 (38℃)	0.35 MPa
ヘリウムリーク率 (atm・cc/sec)	1 × 10 ⁻⁹ (出荷前試験) 10 ⁻¹¹ (設計値)
最高使用温度	140℃
初期清浄度	≤ 10 ppb (H ₂ O、THC)

*1 NaClエアロゾル試験による定格付け

*2 CNCカウンター (TSI Model 3025) で計測した場合の検出限界値

*3 本製品の設計圧力および製品上の表示は 750 PSI=5.2 MPaGであり、全品耐圧試験後出荷しています。ただし、日本国内で使用する場合、本製品は高圧ガス保安法適合品ではありませんので、ガス用途に使用される場合、最高使用圧力は1 MPaGとなります。高圧ガス保安法適合品に関しては、当社各営業所までお問い合わせください。

ガスクリーン IV

製品型式：SGLFPF 6402

①

製品型式：GLFPF 6402

②

①

コード	継手	L寸法(mm)
VMM4	1/4" ガasketシール、オス(VCR ^{*5} 対応)	127
VMM6/8	3/8" ガasketシール、オス(VCR ^{*5} 対応)	127

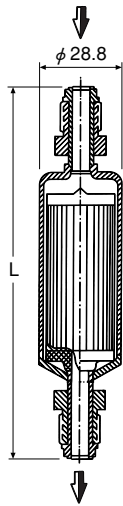
*5 スウェーデンロック社の商標

*6 納期に時間のかかる場合があります。ご了承ください。

②

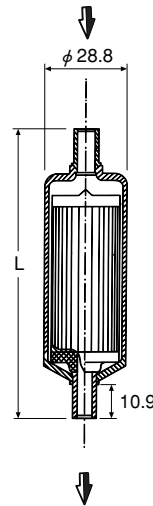
コード	継手	L寸法(mm)	外径(mm)	内径(mm)
BW4 ^{*6}	1/4" バットウェルドチューブ	98	6.35	4.57
BW6 ^{*6}	3/8" バットウェルドチューブ	98	9.52	7.75

ガスケットシール、オス
(VCR対応)

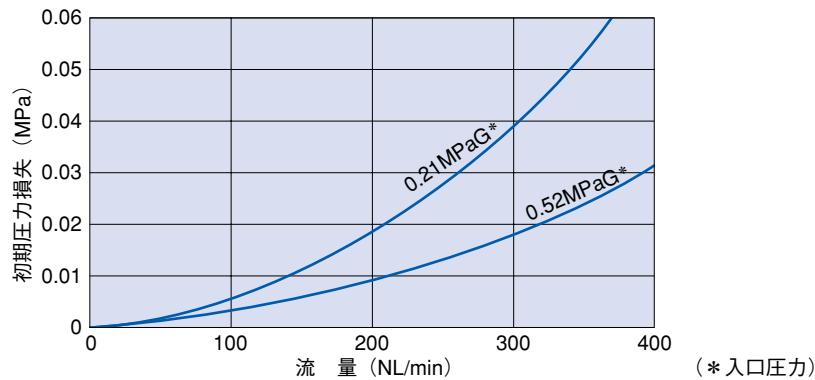


バットウェルドチューブタイプ

(単位：mm)



■流量－圧力損失特性(空気21℃)



本カタログに記載されているデータは特定条件下で得られた代表値です。本カタログに記載された情報により得られる結果並びに本製品の安全性については保証するものではありません。本製品をご使用になる前に、本製品が使用目的に対して適正かつ安全であることをご確認ください。なお、本カタログに記載されている内容は予告無しに変更される場合がございます。

PALL 日本ポール株式会社

ボール インダストリアル カンパニー

〒163-1325 東京都新宿区西新宿 6-5-1

マイクロエレクトロニクス事業部 TEL.03 (6901) 5700

エナジー事業部 TEL.03 (6901) 5780

大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-5-36 TEL.06(6397)3719

熊本営業所 〒862-0956 熊本市水前寺公園 14-22 TEL.096(382)8420